

séances	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
dates	07-févr	08-févr	09-févr	01-mars	02-mars	09-mars	29-mars	30-mars	06-avr	03-mai	04-mai	31-mai	01-juin	07-juin	08-juin	29-juin
binômes																
1		SED3	AU1	TC1	SED1	SED2	AU2	TC2	ET6	ET5		ET4	AU3	ET3	TC3	ET1
2		SED3	AU2	TC1	SED1	SED2		TC2	ET5	ET4	ET3	ET2	AU1	ET1	TC3	ET6
3		SED1	AU3	TC1	SED2	ET1	SED3	TC2	AU1	ET6	ET2	ET3		ET4	TC3	ET5
4		SED1	SED2	TC1	ET1	AU3	SED3	TC2	AU2	ET2	ET4	ET5	ET6	ET7	TC3	
5		AU1	ET1	ET6	TC1	SED3	AU3	ET2	TC2	AU2		SED1	SED2	ET5	ET4	ET3
6		AU2	ET2	ET7	TC1	SED3	AU1	ET1	TC2	AU3	ET5	SED1	SED2		ET6	ET4
7		AU3	ET3	ET5	TC1	AU2	SED1	SED2	TC2	AU1	ET6	SED3	ET4		ET1	ET2
8		ET1	ET5	ET4	TC1	AU1	SED1	SED2	TC2	SED3	AU3	ET7		ET6	ET2	AU2
9		ET2	ET4	AU1	TC1	ET3	SED1	SED2	TC2	SED3	AU2	ET1	ET5		ET7	AU3
10		ET3	ET6	ET1	AU2	ET4	TC1	SED3	ET2	TC2	AU1		SED1	SED2	AU3	TC3
11		ET4	ET7	ET2	AU1	ET5	TC1	SED3	ET1	TC2		AU3	SED1	SED2	AU2	TC3
12		SED1	SED2	ET3	AU3	ET7	TC1	ET6	SED3	TC2	ET1	AU2	ET2		AU1	TC3
13		ET5	SED3	AU2	ET2	ET6	TC1	ET3	SED1	TC2	SED2	AU1	ET1	AU3		TC3
14		ET6	SED3	AU3	ET3	ET2	TC1	ET4	SED1	TC2	SED2		AU2	AU1	ET5	TC3
séances	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Présentation par emplacement (plate-forme) :

Plate-forme MESURE-AUTOMATIQUE-PRODUCTIVE (MAP)

Plate-forme ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE

Plate-forme ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE, TC

		DE PUISSANCE (ETEP)			INDUSTRIELLE (ENII)	
<b>AU1</b>	Commande par retour d'état d'une antenne	<b>ET1</b>	Flyback-Forward	<b>TC1</b>	Amplification et adaptation	
<b>AU2</b>	Commande d'un hacheur Buck	<b>ET2</b>	Cellule de commutation	<b>TC2</b>	Oscillation et mélange	
<b>AU3</b>	Régulation de niveau	<b>ET3</b>	Hacheur commutation dure et douce	<b>TC3</b>	Initiation aux systèmes d'Emission	
<b>SED1</b>	Traitement de surface (1)	<b>ET4</b>	PFC			
<b>SED2</b>	Traitement de surface (2)	<b>ET5</b>	Machine synchrone			
<b>SED3</b>	API et Web	<b>ET6</b>	Machine asynchrone			